

高真空蒸着装置 RD-1250R



高真空蒸着装置RD-1250Rは高校・専門学校・大学の真空工学教育用に開発された装置です。抵抗加熱機構を2対装備しており、サイリスタ制御により蒸着電圧及び、電流値の調整が可能です。真空工学の授業用として開発された本装置は油回転ポンプ、油拡散ポンプ、ガイスラー真空計等専門書で紹介されている機器を標準装備しておりますので、実体験にて学習が可能です。貴学のご要望に合わせて設計・製作可能ですので是非御相談ください。

高真空蒸着装置RD-1250R仕様

- 到達圧力 $\times 10^{-5}$ Pa台※常温・無負荷・脱ガス・液体窒素投入時
- 排気速度 $\times 10^{-4}$ Pa台迄本引開始後10分以内※常温・無負荷・脱ガス・液体窒素投入時
- 装置漏洩量 $\times 10^{-10}$ Pa \cdot m³/sec台※Heリークデテクター検査
- 真空室径 ϕ 230mm \times 240mmH 硬質ガラス
- 蒸着機構 抵抗加熱方式2対切替式(ポート)
抵抗加熱電圧値: AC0~10V可変可能
抵抗加熱電流値: 0~50A可変可能
制御方式: サイリスタ制御
電流計・可変ボリューム・切替スイッチ
- 基板形状 \square 100mm 1枚
- 真空排気系 油回転ポンプ: 200/240L/min[50Hz/60Hz]
油拡散ポンプ: 360L/sec
- 冷却機構 液体窒素トラップ 最大容積: 570cc
- 真空計 ガイスラー真空計(インダクションコイル付)/ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法 手動
- ユーティリティ電気: AC100V単相20A
冷却水: 2L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
寸法: 750mmW \times 500mmD \times (1230mmH)※ベルジャー上昇時
- オプション 水晶振動式膜厚計他、多数のオプション付加&カスタマイズ可能